

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

Requested Patent JP60246635A

Title: AUTOMATIC SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS ;

Abstracted Patent JP60246635 ;

Publication Date: 1985-12-06 ;

Inventor(s): UKAI KATSUZOU; others: 03 ;

Applicant(s): NICHIDEN ANELVA KK ;

Application Number: JP19840103098 19840522 ;

Priority Number(s): ;

IPC Classification: H01L21/302 ; H01L21/68 ;

Equivalents: JP1687724C, JP3057611B

**ABSTRACT:**

**PURPOSE:** To improve yield by a method wherein auxiliary substrates equal in number to a shortage are taken out for transfer and processed substrates and auxiliary substrates are accommodated in different cassettes so that the frequency may be reduced of operators' access into a clean room thereby preventing dust from generation and the substrates from contamination.

**CONSTITUTION:** Cassettes 10, 15 are exclusively for cassette chambers 1, 3 wherein they are fixed eliminating the need of installation or removal. Doors 2, 4 to the cassette chambers 1, 3 will be hardly larger than necessary for the passage of a substrate. Need is reduced of the entry or exit of substrates, lowering the probabilities of dust flowing into the chambers 1, 3. When the number of substrates set in a cassette 21 is different from a number that is the product of the number of stages 9 in an etching room 7 multiplied by a whole number, the insufficiency will be filled up by auxiliary substrates 51 that are automatically transported out of a cassette 41 into a cassette 10 in the cassette chamber 1 via transferring means F, D, and then C. Upon storage of processed substrates 12 into a cassette 15 in the cassette chamber 3, the door 4 is opened, for the separation of the processed substrates 12 into really processed substrates 31 and auxiliary substrates 51 via the transferring means D, F.

## ⑫公開特許公報 (A) 昭60-246635

⑬Int.Cl.<sup>4</sup>H 01 L 21/302  
21/68

識別記号

厅内整理番号  
B-8223-5F  
7168-5F

⑭公開 昭和60年(1985)12月6日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑮発明の名称 自動基板処理装置

⑯特 願 昭59-103098

⑰出 願 昭59(1984)5月22日

⑮発明者	鶴 銀 勝 三	東京都府中市四谷5-8-1	日電アネルバ株式会社内
⑯発明者	齊 藤 韶 夫	東京都府中市四谷5-8-1	日電アネルバ株式会社内
⑰発明者	田 中 郭 巳	東京都府中市四谷5-8-1	日電アネルバ株式会社内
⑮発明者	吉 田 達 彦	東京都府中市四谷5-8-1	日電アネルバ株式会社内
⑯出願人	日電アネルバ株式会社	東京都府中市四谷5-8-1	

## 明 論 書

## 1. 発明の名称

自動基板処理装置

## 2. 特許請求の範囲

所定枚数の基板を一群とし、その複数群の各の上に、逐一連続的かつ自動的に複数の塗膜、糞糞等の処理を施す自動基板処理装置において、被処理基板と処理供基板とゴミー用の補助基板の三者を、それぞれのカセットに分離して収納する基板収納装置と、この基板収納装置の各カセットと基板処理部の間で前記各基板を搬送する基板搬送装置とをそなえ、かつこの基板搬送装置には、基板収納装置から基板処理部に搬送する被処理基板の個数が前記所定枚数に達しないときは、これに補助基板を加えて所定枚数にし、かつ、基板処理部から基板収納装置に搬送する基板は、これを処理供基板と補助基板に分離してそれぞれのカセットに収納する機能を付与したことを特徴とする自動基板処理装置。

## 3. 発明の詳細な説明

## (利用分野)

本発明は、半導体デバイス等を製造する際に用いる半導体基板等の自動基板処理装置に関するものである。

## (背景技術)

高密度に集成された半導体デバイス等の製造では生産歩留りを改善することがきわめて重要である。生産歩留りを上げることで希少かつ貴重な資源を有効に活用し、コスト低減を計ることができる。

高密度集成半導体デバイスの生産歩留りに影響を与える要因として、基板の搬送その他の前処理工程における基板(例えばシリコンウェーハ)へのゴミ(板縫粒子を含む)の付着がある。例えば高密度集成回路の製造工程の中には1mm前後の寸法のラインアンドベースのエッティング工程があるが、この工程で1~2μm前後の板縫粒子がエッティング用マスクとして作用し、その場所にエッティング不良(エッティング張り)を生ずる。エッ

ンダ残りが A1 配線の加工時に生ずるとき、それはすなわち数間のショートとなり半導体デバイスは動作しなくなり歩留りを低下させる。

こうした前処理工程におけるゴミ及び微粒子の付着の原因には、(Ⅲ) 作業者の不注意によるもの、(Ⅳ) 基板の脱着に使用するピンセットなどの工具の汚染によるもの、(Ⅴ) 基板處理部に付けて不可避的に生ずるものがある。これらのうち、(Ⅲ)、(Ⅳ) は作業者の介在によって生ずるもので、これのほか云を目標して前処理工程を出来るだけ作業者を煩わさないものにする自動化装置の採用が増加している。

さて、第2図は従来のドライエッティング工程における自動基板処理装置の概略を示す図である。被処理基板 11 はカセット 10 に 1 枚または複数枚収納された状態で扉 2 を開けて右方の外気側からカセット室 1 に投入収納される。被処理基板 11 はこのあと、トランスファー室 5 に受けられたフォータ 6 によって自動的にエッティング室 7 の電板 8 上に受けられたステージ 9 に搬送される。第1図では電板 8 の上に合計 8 個のステージ 9 が設

けられているためこれに 8 枚の被処理基板を配置して 8 枚が一群となって同時にエッティングされるがカセット 10 内にたまたま 8 の整数倍の枚数の基板 11 がない場合には、電板 8 上に不足分の空きステージを生ずることとなる。この状態でエッティングを行なうと、空きステージは過度の活性プラズマに晒され、ステージ 9 のその部分の表面がエッティングされたり、あるいはこの表面に反応生成物や重合物が堆積するなどし、損傷あるいは汚染されるなどの問題を生ずる。このため、こうした場合には空きステージの上にはタミー用の補助基板を置いてこれをエッティングさせるようしている。

この補助基板は、被処理基板 11 が入っているカセット 10 をカセット室 1 に搬入する前に、作業者が被処理基板 11 の枚数を数えて、それが前記した一群の枚数の 8 の整数倍になるよう調整しているもので、この場合の基板の出し入れにはピンセットを用いているが、これがゴミの発生を促進することになっている。この枚数調整作業は

上述のローディング(投入)作業時だけでなく、アンローディング(回収)作業時にも必要である。即ち、図示のように、処理後の基板にはカセット室 3 に配置されたカセット 15 内に補助基板と一緒に回収されるので、カセット室 3 からカセット 15 を取り出した際に不要な補助基板を抜き取る作業が必要である。この際にもゴミ付着の機会を生ずる。従って、上記の作業を自動化するとともに、その作業を密閉した室内で行うような装置が必要となる。

#### (発明の構成)

本発明はこの問題を次の構成の装置で解決するものである。即ち、上記の第2図の装置を基板処理部として、その前・後段に基板搬送装置およびそれに連なる基板収納装置を設備し、基板収納装置には、被処理基板、処理供基板と、タミー用の補助基板の三者をそれぞれ区別して収納し、これに対応して基板搬送装置には次の(A)、(B) の機能を持たせたものである。

#### (A) 基板収納装置から基板処理部に搬送する被処

理基板の個数が、前記の一群の枚数(前記では 8 枚)に達しないときは、補助基板収納のカセットから、不足枚数だけの補助基板を取出して搬送する。

(B) 基板処理部から基板収納装置に基板を搬送するときには、基板を処理供基板と補助基板に区別してそれぞれのカセットに収納する。

#### (実施例)

以下、図に基いて本発明の実施例を説明する。第1図において、基板処理部 A は、カセット 10 の形状を除けば第2図と同一の基板処理装置である。この実施例ではカセット 10、15 はカセット室 1、3 の専用となってこゝに固定され脱着の必要がないものになっている。またこれに伴つて、(第1図には第2図と同じ大きさに描いたが)カセット室の扉 2、4 も基板が通過できるだけの最小開口でよいものとなる。カセット 10、15 の出し入れが省略されるので、その分だけ真空室へのゴミの流入の確率が小さくなる。

第2図の B 部の基板搬送装置 60 と基板収納装置

置70は本実施例で付設された部分である。基板取納装置70の内では処理前の被処理基板21はカセット20に収納され、処理後の基板31はカセット30に収納され、ゴミ用の補助基板51はカセット41、42に収納されている。カセット室1、3に固定されている既述のカセット10、15と基板取納装置70の各カセットの間の基板の搬送を基板搬送装置60が受持つ。即ち、カセット室1のカセット10の被処理基板11がなくなったり場合には、脚2を向いて、基板取納装置70内にあらかじめ投入されている被処理基板21がカセット20から、搬送器にて搬送されてくるようになっている。そしてこの場合、もしかカセット21にセットされている基板の枚数が、エッティング室7に設けられたステージ9の個数（これは一回で処理される枚数であって、図の場合は8個）の整数倍になっていない場合には、（この検出はカウンターの設置などで比較的簡単に実現される。図示していない。）不足枚数だけの補助用基板51がカセット41より搬送器F-D-Cを

経由して、カセット室1のカセット10に自動的に搬送補給されるようになっている。次に、既述の基板処理を終えてエッティング室7からトランスマッパー室5を経由して、処理済基板12がカセット室3のカセット15に納められた後は、脚4が開かれ、処理済基板12が搬送器F-Dによって処理済基板31と補助基板51に区分けされて、それぞれがカセット30とカセット41または42に送られ収納される。処理済基板31と補助基板51の区別けは、例えば補助基板51の周縁部にあらかじめ切欠きを設けておき、搬送器Dにはその切欠きを検出する機能を付与しておくなどの方法でこれも比較的簡単に実現される。従って、その詳細の図示・説明は省略する。

なお、上述の被処理基板個数の検出とそれに基づく補助基板の追加と、処理済基板と補助基板の区別けと各カセットへの区分け搬送などは、簡単な配線装置と中央処理装置をそなえた電子的な制御器（第1図に1点録画のブロック80で示す）を、基板搬送装置60に付設して行わせることで

も、容易に達成できる。補助基板51のカセット41または42への収納は41、42の一方が空になってしまった時点または溝杯になってしまった時点で供給用と回収用が自動的に変換されるものとなっている。そのため補助基板は一定の枚数のものが搬出し基板処理部に供給され、かつそこから回収される。肝心なことは、これらの移動がすべて装置内で人手によらずして行なわれることで、装置の清潔性の維持は容易となる。なお、本実施例では、基板取納装置70内に被処理基板用、処理済基板用及び補助基板用に各2コのカセット20、30及び41と42を用いたが、これらのカセットの個数には制限はない。

さらに、本実施例には、次の两点次の効果がある。即ち、実工場に先だって基板処理部のウォーミングアップを行うことがこの種の装置では不可欠であるが、その場合、被処理基板用のカセット20に、故意に基板を挿入せずに、操作を開始すれば補助用基板が自動的に必要数基板処理部1に搬送され処理され、かつ返送されその動作が繰り返される。

て所望枚数のウォーミングアップが実行されるという効果がある。この點の装置の清潔性も確保される。

以上は本発明の一実施例をドライエッティング装置について詳細に述べたものであるが、エッティング装置に限定されることなく本発明は半導体製造装置等他の処理工場にも広範囲に利用できることはいうまでもない。

#### （発明の効果）

本発明の自動基板処理装置は、タリーンルーム内への作業者の立入りを低減し、ゴミの発生付着の機会を極小にし、処理基板の歩留りを向上させる効果がある。自動化による省力の効果も著しい。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例の自動基板処理装置の概略図、第2図は従来の基板処理装置の概略図である。

1、3…カセット室 5…トランスマッパー室  
7…エッティング室 6…フォーク

8 ……電 機  
10, 15, 20, 30, 41, 42 ……カセット  
11, 21 ……板処理基板, 12, 31 ……処理供基板  
51 ……補助基板, 60 ……基板搬送装置  
70 ……基板収納装置  
A ……基板処理部

特許出願人 日電アネルバ株式会社

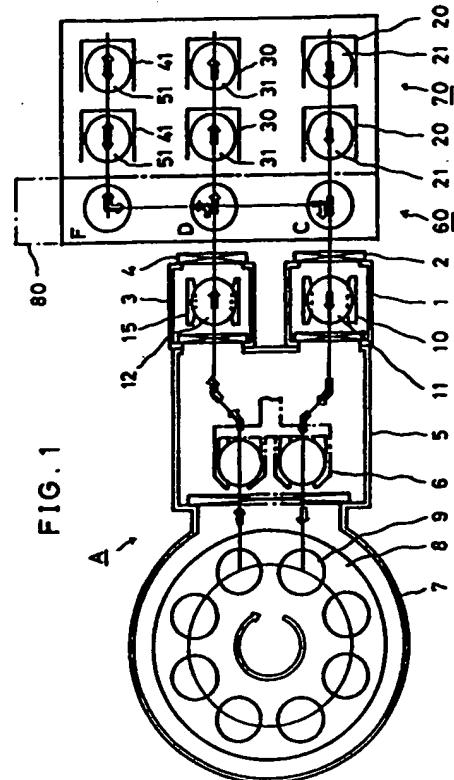


FIG. 1

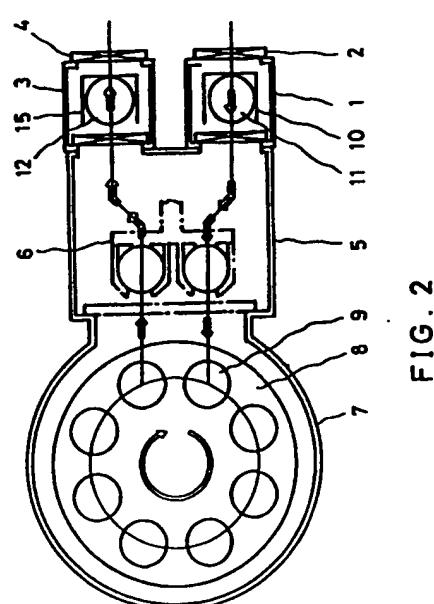


FIG. 2

## 手 続 極 正 書 (自 民)

昭和59年7月13日

特許庁長官

殿

## 1. 事件の表示

昭和59年特許願第103098号

## 2. 発明の名称

自動基板処理装置

## 3. 極正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 東京都府中市四谷5-8-1

氏名 日電アネルバ株式会社

代表者 田 喜次郎



## 4. 極正命令の日付 昭和 年 月 日

## 5. 極正により増加する発明の数 0

## 6. 極正の対象

明細の発明の詳細な説明の欄。図面。

## 7. 極正の内容

別紙のとおり



## 補正の内容

- 明細書第3頁20行目の「1図では」を「2図では」と補正する。
- 同第6頁11行目の「0の形状」を「0および15の形状」と補正する。
- 同20行目の「第2図のB部」を「第1図の」と補正する。
- 図面の第1図の符号の一部を紙面の赤字の如く補正する。  
即ち、第1図の符号の左上部の「41」を「42」に補正する。

(以上)

